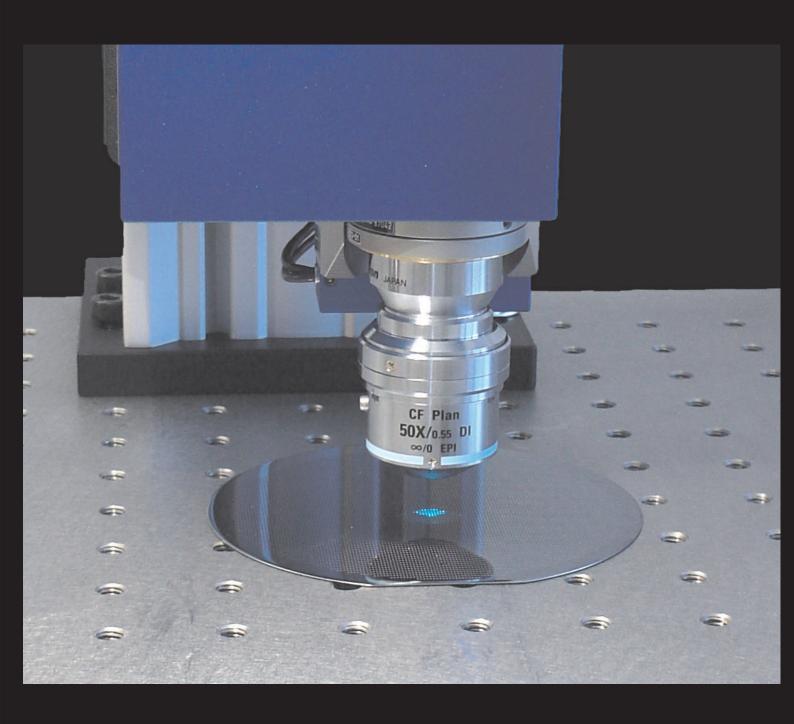
WLI moB

Die neue Dimension



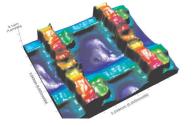


Das ideale Messgerät zur sekundenschnellen Erfassung superglatter bis moderat strukturierter mikroskopischer und makroskopischer Oberflächen. Hervorragende Profiltreue und detaillierte Wiedergabe auch kleinster Details bei höchster axialer Auflösung.

- Interferometrische Technologie zur Erfassung kleinster Details bis ans physikalische Limit.
- Flächenerfassendes Messverfahren für schnelle Ergebnisse.
- Robust, wartungsfrei, langlebig.
- ► Umfangreiches Sortiment an ausgesuchten Objektiven höchster Qualität verfügbar.
- Messung von Topografie, Höhe, Form, Position und Ebenheit
- Bestimmung abgeleiteter Größen wie Rauheit, Fläche oder Volumen

Prädestiniert für den Einsatz zum Beispiel

- ➤ im Halbleiterbereich
- ▶ in der Optik, Materialforschung, Maschinenbau
- Medizintechnik
- ► Automobilindustrie, Dichtflächen



Fotodiodenzelle in CMOS-Array $50 \times 40 \mu m$

WLI Weißlichtinterferometer

Durch Überlagerung des von der Probe reflektierten Lichts mit einer Messprinzip im Objektiv erzeugten Referenzwelle ergeben sich in einem kleinen Bereich um die optimale Fokuslage charakteristische Intensitätsvariationen im Kamerabild. Ausgefeilte Algorithmen

bestimmmen daraus Profilhöhe und Interferenzkontrast.



Kamera Kameraauflösung 768x576² Pixel, bis 48 Bilder/s. Beleuchtung

Beleuchtung über integrierte Hochleistungs LED mit 505nm (blau-

grün).

Messbereich 100, 250 oder 400 μ m, je nach Objektivversteller

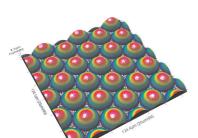
Softwareoption für Messbereichserweiterung über externen

Versteller

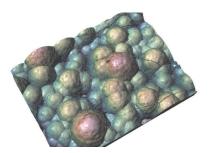
2.5x 50x 100x Objektiv 5x 10x 20x 0.0750.13 0.3 0.40.55 0.7 numerische Apertur 9.3 7.4 4.7 10.3 3 4 2.0 Arbeitsabstand(mm) 7120x5340 3560x2670 1 780x1335 890x655 356x267 178x134 Bildfeld (μ m x μ m) Auflösung lateral (μ m) $^{+}$ 9.24 4.62 2.31 1.16 0.463/0.61 0.231/0.48 Auflösung axial (nm) 1.0 1.0 1.0 0.1 0.1 0.1

ca. 220 x 93 x 65mm mit Objektiv und Piezoversteller Abmessungen

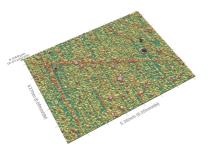
USB 2.0, RS232, DLL zur Integration in OEM-Software verfügbar Systemeinbindung



Mikrolinsenarray 125 x 125 μm



Walzenoberfläche $300 \times 230 \,\mu\text{m}$



Dichtfläche 360 x 270 μm

geometrisch/optisch

² Megapixelkamera optional verfügbar Technische Änderungen vorbehalten



Nobelstraße 7 76275 Ettlingen

49(0)7243/529942 49(0)7243/524480 Telefax info@opm-messtechnik.de www.opm-messtechnik.de